# 三波长合束高亮度半导体激光光源

张 俊<sup>1,2</sup> 彭航宇<sup>1\*</sup> 刘 云<sup>1</sup> 秦 莉<sup>1</sup> 单肖楠<sup>1</sup> 王立军<sup>1</sup>

(<sup>1</sup>中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033 <sup>2</sup>中国科学院大学,北京100049

**摘要** 半导体激光器以其突出的优点具有广泛的应用前景,但受光束质量限制,使其很难作为直接光源应用在对 功率和光束质量均有较高要求的领域。采用斜 45°柱透镜阵列光束整形技术、自偏振合束技术和三波长合束技术, 将 3 种波长的 8 个半导体激光阵列合束,研制出一种连续功率为 500 W、电光转换效率为 39.5%、光参量积为 12.44 mm•mrad、亮度为 42.8 MW/(cm<sup>2</sup>•sr)的半导体激光光源,可作为直接光源应用于工业和国防等领域。 关键词 激光器;高亮度;光束整形;自偏振合束;波长合束

中图分类号 TN248.4 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201340.0402011

## High Brightness Diode Laser Source Based on Three-Wavelength Multiplexing

Zhang Jun<sup>1,2</sup> Peng Hangyu<sup>1</sup> Liu Yun<sup>1</sup> Qin Li<sup>1</sup> Shan Xiaonan<sup>1</sup> Wang Lijun<sup>1</sup>

[ <sup>1</sup> Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences,

Changchun, Jilin 130033, China

 $^{\rm 2}$  University of Chinese Academy of Sciences , Beijing 100049 , China

**Abstract** Because of the prominent advantages, diode lasers have a significant prospect of application. But limited by the beam quality, it is difficult to be a direct source applied in the fields demanding for power, beam quality and brightness at the same time. The technologies of beam shaping of  $45^{\circ}$  tilted cylindrical lens, self-polarization multiplexing and three-wavelength multiplexing are employed to couple 8 bars with three wavelengths into a laser beam, and a diode laser source is developed with continuous wave (CW) power of 500 W, electro-optical conversion efficiency of 39.5%, holistic beam quality of  $12.44 \text{ mm}\cdot\text{mrad}$  and brightness of  $42.8 \text{ MW/(cm}^2 \cdot \text{sr})$ , which can be applied directly in the fields of materials processing and defense.

Key words lasers; high brightness; beam shaping; self-polarization multiplexing; wavelength multiplexing OCIS codes 140.2020; 140.3298; 140.3300; 140.3320

### 1 引 言

近年来,随着半导体激光技术的快速发展,激光 器件的性能也实现了重大突破:电光转换效率达 70%以上<sup>[1~7]</sup>、单阵列连续输出功率超过千瓦<sup>[8]</sup>、 100 μm条宽单管输出功率超过 20 W<sup>[9~14]</sup>、高功率 连续工作寿命长达数万小时<sup>[15~18]</sup>等。但由于自身 结构原因导致的光场分布不均匀、光束质量差和功 率密度低等缺点<sup>[19]</sup>,使得高功率半导体激光器很难 作为直接光源应用在激光加工和国防领域,这也成 了半导体激光发展的瓶颈问题。激光合束技术被证

收稿日期: 2012-10-24; 收到修改稿日期: 2012-12-03

基金项目:国家 863 计划(2012AA040210)、吉林省科技厅发展计划项目(20112106)和院地合作项目(2011CJT0003)资助 课题。

作者简介:张 俊(1986—),男,博士,主要从事大功率半导体激光器线阵合束技术方面的研究。

E-mail: jzh\_ciomp@163.com

**导师简介:**王立军(1946—),男,研究员,博士生导师,主要从事大功率半导体激光技术方面的研究。

E-mail: wanglj@ciomp.ac.cn

\*通信联系人。E-mail: imphy@163.com

明是解决该问题的有效途径之一。

国际上激光合束技术的研究发展十分迅速,基于 激光阵列的半导体激光合束光源已实现数千瓦甚至 上万瓦功率连续输出<sup>[20~22]</sup>,作为直接光源已应用于 激光焊接、激光熔覆和表面硬化等加工领域[23,24],研 制出芯径为400 µm、数值孔径(NA)为0.1的光纤连 续输出的 2000 W 商用激光源,光束质量为 20 mm•mrad,亮度达到 50.7 MW/(cm<sup>2</sup>•sr)。国内发 展相对滞后,西安炬光开发的激光光源在 76.5 mm 工 作距离处实现了尺寸为2mm×8mm、功率为4000W 的激光输出,未提供光束质量指标。北京工业大学研 制的1 kW 半导体激光光源快轴方向光束质量为 26.1 mm•mrad,未提供慢轴方向的光束质量<sup>[25]</sup>。电 子十三所研制的激光迭阵实现 1600 W 功率输出, 快轴发散角准直到 6 mrad<sup>[26]</sup>。本实验组开展了系 列激光合束的研究[27~29],其中采用 20 个激光阵列 实现了 1030 W 功率、两轴光参量积(BPP)分别为 18.3 mm·mrad 和17.7 mm·mrad 的激光输出,亮 度为 19.9 MW/(cm<sup>2</sup> • sr)<sup>[29]</sup>。

本文在前期工作的基础上,通过自偏振合束和 三波长合束技术,将 3 种波长的 8 个半导体激光阵 列激光合束,实现连续功率 500 W、电光转换效率 39.5%、X 方向和 Y 方向的光参量积分别为  $8.58 \text{ mm} \cdot \text{mrad} \pi 8.51 \text{ mm} \cdot \text{mrad} 、整体光参量积为$  $12.44 \text{ mm} \cdot \text{mrad} 、亮度为 42.8 MW/(cm<sup>2</sup> \cdot sr)的激$ 光输出,进一步提高了半导体激光亮度。

#### 2 理论设计

半导体激光器的光束质量一般用光参量积 Q 来评价,定义为束腰半径 W。与远场发散半角 θ/2 的乘积<sup>[19]</sup>:

$$Q = W_{\scriptscriptstyle 0} \, ullet \, heta/2$$
 ,

Q值越小,光束质量越好。

亮度(B)表示单位面积单位立体角内的激光功率,用来评价激光束能够被聚焦的能力。相同功率条件下,亮度越高,代表能够被聚焦的光斑越小,获得的功率密度就越大,因此不论是作为抽运源还是直接光源,都具有非常重要的意义<sup>[19]</sup>。亮度具体定义为

$$B = \frac{P}{A \cdot \Omega},\tag{2}$$

式中 A 为激光束腰处的光斑面积, Ω 为激光束的立体角。

由于半导体激光为非旋转对称分布,在相互垂直的 X 和 Y 方向的束腰半径  $W_{x0}$  和  $W_{y0}$  与发散角  $\theta_{x0}$  和  $\theta_{y0}$  均各不相同,近似于矩形分布,则其光斑束 腰面积和立体角分布分别为  $A = 4W_{x0} W_{y0}$ ,  $\Omega = \theta_{x0} \theta_{y0}$ ,对应的亮度 B 变为

$$B = \frac{P}{16Q_x Q_y},\tag{3}$$

式中 $Q_x = W_{x0}\theta_{x0}/2$ ,  $Q_y = W_{y0}\theta_{y0}/2$ , 分别为两个方向的光参量积。

实验采用的半导体激光器结构参数如表1所示。 为了便于说明,坐标定义如下:X轴平行于激光条外 延层,Y轴垂直于外延层,激光出射方向为Z轴。@.表 示平行于外延层方向的发散角,即慢轴方向发散角; Ø,为垂直于外延层的发散角,即快轴发散角。

在未进行光束变换之前,X 为慢轴方向,Y 为快轴 方向。根据(1)式可知,三种波长激光器快轴方向光参 量积  $Q_i$  为 0.275~0.3 mm•mrad,接近衍射极限( $Q_d = \lambda/\pi \approx 0.263$  mm•mrad),慢轴方向光参量积  $Q_s = 349$  mm•mrad,约为快轴方向的 1269 倍,两轴光参量积 差别大。另外 793 nm 和 870 nm 激光器上发光点的慢 轴方向光束质量均为 3.05 mm•mrad,825 nm 为 4.58 mm•mrad,是 793 nm 和 870 nm 的 1.5 倍。

	表 1	半导体激光阵列	结构参	参数表		
Table 1	Struc	ure parameters of	of the	diode	laser	bar

Wavelength / nm	Width of bars /mm	Number of emitters	Width of emitters $/\mu m$	Filling factor / %	$\Theta_x$ (95% of power) /(°)	$\Theta_y$ (95% of power) /(°)	Diffractive limited $Q/(\text{mm}\cdot\text{mrad})$
793	10	19	$1 \times 100$	20	7	63	0.253
825	10	19	$1 \times 150$	30	7	63	0.263
870	10	19	$1.5 \times 100$	20	7	46	0.277

斜 45°柱透镜阵列首先被用来对半导体激光阵列 整形<sup>[28]</sup>,如图 1 所示,它将激光阵列上每个发光点输出 的光束直接翻转 90°,使得激光束 Y 方向变为慢轴方 向,而 X 方向转变为若干个发光点快轴方向的叠加,呈 19 条竖线,该方向整个光斑尺寸约为 9.4 mm,由于快 轴准直,该方向的发散角可达到 7 mrad,则 X 方向的光 束质量变为 16.45 mm•mrad,Y 方向的光参量积由自身 结构决定,分别为 3.05、4.58、3.05 mm•mrad,两轴的光 束质量差别由上千倍降至几倍,有利于两轴光束质量 均衡。



图 1 经过斜 45°柱透镜阵列对快慢轴光束翻转 Fig. 1 Beam shaping with a 45° tilted cylindrical lens array



为了使三者在 Y 方向的 Q 值一致,825 nm 激 光器在该方向叠加 2 层,793 nm 和 870 nm 激光器 分别叠加 3 层,在不考虑中间缝隙的条件下,三者在 Y 方向的 Q 值均为 9.16 mm•mrad,如图 2 所示。

为了降低激光束在 X 方向的 Q 值,利用半导体 激光输出线偏振光特性,采用如图 3 所示的自偏振 合束方式,将宽度为 d 的 p 偏振激光,一半经过半 波片变为 s 偏振光,与另一半 p 偏振光合束,在发散 角不变的条件下,激光光斑减小一半变为 d/2,从而 将 Q 值减小一半,变为 8.3 mm•mrad。



图 2 (a) 792 nm 和 870 nm 激光在 Y 轴方向叠加 3 层; (b) 825 nm 激光在 Y 轴方向叠加 2 层 Fig. 2 (a) Overlap 3 layers at the Y axis of 792 nm and 870 nm; (b) overlap 2 layers at the Y axis of 825 nm



图 3 自偏振合束光斑整形

Fig. 3 Beam shaping by self-polarization multiplexing

为了提高输出功率,采用两次波长合束实现三 束不同波长的激光完全重叠在一起的方案。考虑到 所使用的波长合束镜透射效率明显低于反射效率, 为提高合束效率,尽量减小透射光的数量,采用图 4 所示方式合束,其中 793 nm 激光经过一次透射 (T),825 nm 激光经过一次透射和一次反射(R), 870 nm激光经过两次反射。

为了均衡两个方向的发散角和光斑尺寸,在合 束后采用倒置式望远镜系统对激光束进行扩束,压 缩 X 方向的发散角。



图 4 波长合束过程 Fig. 4 Process of wavelength multiplexing

#### 3 实验结果及分析

实验采用 8 个传导冷却热沉封装的半导体激光 阵列,其中 793 nm 和 870 nm 激光器各 3 个,825 nm 为 2 个,固定在台阶底座热沉上,每个激光器首先经 过快轴准直,45°斜柱透镜阵列光束变换和慢轴准直, 然后通过相应的反射镜 90°偏折光路,在 Y 方向实现 空间叠加。图 5(a)为 3 个 870 nm 激光器空间合束后 光斑图, X 方向为 10 mm, 为快轴方向, Y 方向的空间 间隔主要由该方向慢轴准直后的光斑宽度决定, 对于 793 nm 和 870 nm 激光器,其间隔为 4.5 mm, 而对于 825 nm 激光器,其间隔为 6.8 mm。合束之后的光 束经过自偏振合束棱镜,实现光斑在 X 方向的对 折,在 X 方向的光斑宽度变为 5 mm, 如图 5(b) 所示。



图 5 3个 870 nm 激光器。(a)空间合束光斑图;(b)自偏振合束后光斑图

Fig. 5 Laser spots of (a) spatial overlapping and (b) self-polarization multiplexing by 3 laser bars of 870 nm

以下测试均在冷却液流量为 11 L/min,温度为 18 ℃的条件下进行。

沿光轴方向、距出光口 0.1 m 处,采用 Ophir 5000 W 水冷功率计测激光连续输出功率,功率效率 曲线如图 6 所示。当驱动电流达到 87 A 时,连续输 出功率为 500 W,此时电光转换效率为 37.5%,当 电流为 50 A 时,获得的最高转换效率为 39.5%。



#### 图 6 半导体激光光源的功率、效率和电压随 电流的变化曲线

Fig. 6 Curve of the diode laser coupling source of optical power, forward voltage and conversion efficiency versus operating current

采用 Ando AQ6317B 光纤光谱仪测量激光器 输出光谱,在 I=70 A 时,输出激光光谱如图 7 所 示。3 个中心波长分别为 792.5、825.4、870.0 nm, 其半峰全宽光谱宽度分别为 2.8、2.7、3.4 nm。

采用 Primes Focus Monitor 光束质量分析仪,



图 7 当 *I*=70 A 时半导体激光光源输出激光光谱, 3 个中心波长分别为 792.5、825.4、870.0 nm

Fig. 7 Spectrum of the diode laser source at current of 70 A at the central wavelengths of 792.5, 825.4, 870.0 nm

在未进行任何衰减的条件下测量激光光束质量。激 光束首先经过焦距为 100 mm 的透镜聚焦,然后利 用光束质量分析仪,扫描焦点处前后共 6 倍瑞利距 离的光斑并拟合,当电流为 50 A 时,测试结果如 图 8所示,以二阶距法标定光斑尺寸<sup>[30]</sup>,测得整体光 束质量为 12.4 mm•mrad。

聚焦光束焦点处光斑如图 9 所示, X 和 Y 方向的光斑尺寸分别为 0.264 mm 和 0.252 mm, 由光场分布可知, X 为快轴方向, Y 为慢轴方向, 聚焦前激光束在快轴和慢轴方向的发散角分别为 2.64 mrad和 2.52 mrad。



presentation: 2nd moment

图 8 I=50 A时,整体光束质量为 12.4 mm·mrad(测试仪器:Primes Focus Monitor) Fig. 8 Holistic beam quality of 12.4 mm·mrad at current of 50 A tested by Primes Focus Monitor





距出光口 0.1 m 处的光斑由 Spiricon CCD 成 像方式测得,电流为 7.2 A 时的测试结果如图 10 所 示,在 Y 方向可明显看到 3 个光斑,相邻光斑间隔 为 4.5 mm,由于测试电流在 870 nm 激光器的阈值 附近,825 nm 激光器的阈值较高,光斑不明显,此时 光斑外形尺寸为 13 mm×13.5 mm。

根据(1)式可得到两个方向的光束质量: $Q_x = 8.58 \text{ mm} \cdot \text{mrad}; Q_y = 8.51 \text{ mm} \cdot \text{mrad}_{\circ} 对角线的光$  $束质量为 12.1 mm \cdot \text{mrad}, 与测试的整体光束质量 12.4 mm \cdot \text{mrad} 匹配。$ 

由激光亮度(3)式,得到该半导体激光光源亮度



图 10 *I*=7.2 A 时,距出光口 0.1 m 处的光场分布 (测试仪器:Spiricon CCD)

Fig. 10 Intensity distribution of the spot at 0.1 m from the outlet at the current of 7.2 A, measured by Spiricon CCD

为 42.8 MW/(cm<sup>2</sup>•sr),若聚焦成数值孔径为 0.22 的光束,其束腰处功率密度将达到 6.51 MW/cm<sup>2</sup>。 该激光源既可耦合进光纤柔性输出,也可以作为直 接光源应用。在该激光源的基础上,耦合更多的波 长,如 915、940、980、1060 nm 等,在光束质量不变 的条件下,输出功率和亮度将获得倍数增加。

测得的数据中,Y方向的Q值低于理论值,主要 原因分析如下:慢轴准直镜设计焦距为36.8 mm,准 直后的发散角和光斑尺寸分别为2.72 mrad和 4.50 mm。而根据实际测得慢轴方向的发散角为 2.52 mrad,低于设计值,则推测慢轴准直镜的焦距大 于设计值,约为40 mm,相应的准直光斑为4.85 mm, 而在经过与之对应的反射镜反射时,由于预留空间保持4.5 mm,大于4.5 mm的光直接被反射镜漏掉或 挡掉而损失,最终输出光斑仍保持4.5 mm,因此相应 的单束激光输出光束质量就小于理论值,实际为 2.835 mm•mrad,三束光合束后为8.51 mm•mrad。

#### 4 结 论

综合应用光束整形、空间合束、自偏振合束和三波 长合束技术,将3种不同波长的8只半导体激光阵列 耦合成一束光,实现连续功率为500W、整体光束质量 为12.44 mm•mrad、亮度达到42.8 MW/(cm<sup>2</sup>•sr)的高 功率、高光束质量、高亮度的激光输出。

目前,基于半导体激光器的直接光源已成功应 用在激光加工、激光医疗等领域。随着高功率半导 体激光器光束质量和亮度的提高,具有高效节能、高 功率、高光束质量、高亮度的半导体激光光源将在未 来激光加工领域占有重要地位,并将在国防领域发 挥重要作用。

#### 参考文献

- 1 N. A. Pikhtin, S. O. Slipchenko, Z. N. Sokolova et al., 16 W continuous-wave output power from 100 μm-aperture laser with quantum well asymmetric heterostructure [J]. Electron. Lett., 2004, 40(22): 1413~1414
- 2 M. Kanskar, T. Earles, T. J. Goodnough *et al.*, 73% CW power conversion efficiency at 50 W from 970 nm diode laser bars [J]. *Electron. Lett.*, 2005, **41**(5): 245~247
- 3 Matthew Peters, Victor Rossin, Matthew Everett *et al.*. Highpower, high-efficiency laser diodes at JDSU[C]. SPIE, 2007, 6456: 64560G
- 4 Paul Crump, Weimin Dong, Mike Grimshaw *et al.*. 100-W + diode laser bars show >71% power conversion from 790-nm to 1000-nm and have clear route to >85%[C]. *SPIE*, 2007, **6456**: 64560M
- 5 Götz Erbert, Frank Bugge, Andrea Knigge *et al.*. Highly reliable 75 W InGaAs/AlGaAs laser bars with over 70% conversion efficiency[C]. SPIE, 2006, **6133**: 61330B
- 6 Hanxuan Li, Irving Chyr, Denny Brown et al.. Ongoing development of high-efficiency and high-reliability laser diodes at Spectra-Physics[C]. SPIE, 2007, 6456: 64560C
- 7 P. A. Crump, M. Grimshaw, J. Wang et al.. 85% power conversion efficiency 975-nm broad area diode lasers at -50 °C, 76% at 10 °C [C]. Conference on Lasers and Electro-Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference and Photonic Applications Systems Technologies, 2006. JWB24
- 8 V. V. Bezotosnyi, V. Yu. Bondarev, O. N. Krokhin *et al.*. Laser diodes emitting up to 25 W at 808 nm [J]. *Quantum Electron.*, 2009, **39**(3): 241~243
- 9 M. Zorn, R. Hülsewede, H. Schulze *et al.*. New developments of high-power single emitters and laser bars at JENOPTIK[C]. SPIE, 2011, 7918: 79180S
- 10 P. Crump, C. Roder, R. Staske *et al.*. Limitations to peak continuous wave power in high power broad area single emitter 980 nm diode lasers[C]. Lasers and Electro-Optics 2009 and the European Quantum Electronics Conference. 2009
- 11 B. Petrescu-Prahova, P. Modak, E. Goutain *et al.*. 253 mW/ $\mu$ m maximum power density from 9xx nm epitaxial laser structures with  $d/\Gamma$  greater than 1  $\mu$ m[C]. IEEE 21st Int. Semicond. Laser Conf.,

- 12 Norbert Lichtenstein, Martin Krejci, Yvonne Manz *et al.*. Recent developments for BAR and BASE: setting the trends [C]. *SPIE*, 2008, **6876**: 68760C
- 13 Zuntu Xu, Wei Gao, Lisen Cheng *et al.*. Highly reliable, high brightness, 915 nm laser diodes for fiber laser applications[C]. *SPIE*, 2008, **6909**: 69090Q
- 14 P. Crump, G. Blume, K. Paschke *et al.*. 20 W continuous wave reliable operation of 980 nm broad-area single emitter diode lasers with an aperture of 96  $\mu$ m[C]. *SPIE*, 2009, **7198**: 719814
- 15 D. Lorenzen, Jens Meusel, Dominic Schröder *et al.*. Passively cooled diode lasers in the CW power range of 120 to 200 W[C]. SPIE, 2008, 6876: 68760Q
- 16 R. Hülsewede, H. Schulze, J. Sebastian *et al.*. High brilliance and high efficiency: optimized high power diode laser bars[C]. *SPIE*, 2008, 6876: 68760F
- 17 M. Zorn, R. Hülsewede, H. Schulze *et al.*. JENOPTIK diode lasers and bars optimized for high-power applications in the NIR range[C]. SPIE, 2010, **7583**: 75830U
- 18 Victor Rossin, Matthew Peters, Erik Zucker *et al.*. Highly reliable high-power broad area laser diodes [C]. SPIE, 2006, 6104: 610407
- 19 F. Bachmann, P. Loosen, R. Poprawe. High Power Diode Lasers Technology and Applications [M]. New York: Springer, 2007. 121~125
- 20 David G. Matthews, Klaus Kleine, Volker Krause *et al.*. A 15 kW fiber-coupled diode laser for pumping applications [C]. *SPIE*, 2012, 8241: 824103
- 21 David Havrilla, Marco Holzer, Rüdiger Brockmann et al.. Dramatic advances in direct diode lasers[C]. SPIE, 2010, 7583: 75830B
- 22 Harald König, Günther Grönninger, Christian Lauer *et al.*. Scaling brilliance of high power laser diodes [C]. SPIE, 2010, 7583: 75830T
- 23 Andre Timmermann, Jens Meinschien, Peter Bruns *et al.*. Next generation high-brightness diode lasers offer new industrial applications[C]. SPIE, 2008, 6876: 68760U
- 24 Stephan Strohmaier, Christoph Tillkorn, Peter Olschowsky et al.. High-power, high-brightness direct-diode lasers[J]. Optics & Photonics News, 2010, 21(10): 25~29
- 25 Ding Peng, Cao Yinhua, Su Guoqiang *et al.*. 1 kW high power diode laser with polarization coupled by Gran-Taylor prism[J]. *Chinese J. Lasers*, 2009, 36(2): 290~293
  丁 鹏,曹银花,苏国强等.使用格兰-泰勒棱镜偏振耦合的 1 kW大功率半导体激光器[J].中国激光,2009,36(2): 290~293
- 26 Xu Huiwu, Ren Yongxue, An Zhenfeng *et al.*. Packaging of 808 nm 1500 W continuous wave operation perpendicularity laser diode stack [J]. *Chinese J. Lasers*, 2010, **37**(11): 2769~2773 徐会武,任永学,安振峰 等. 808 nm 连续 1500 W 阵列激光器封 装[J]. 中国激光, 2010, **37**(11): 2769~2773
- 27 Peng Hangyu, Gu Yuanyuan, Shan Xiaonan et al.. Study on beam shaping of high power diode lasers [J]. Chinese J. Lasers, 2011, 38(2): 0202010 彭航宇, 顾媛媛, 单肖楠等. 大功率半导体激光光源光束整形技 术研究[J]. 中国激光, 2011, 38(2): 0202010
- 28 Peng Hangyu, Shan Xiaonan, Ma Junlong *et al.*. 2600 W high efficiency laser diode source with polarization coupling [J]. *Chinese J. Luminescence*, 2011, **32**(10): 1036~1040 彭航宇, 单肖楠, 马军龙等. 2600 W 偏振耦合高效率半导体激 光光源[J]. 发光学报, 2011, **32**(10): 1036~1040
- 29 Zhang Jun, Shan Xiaonan, Liu Yu et al.. kW-output high beam quality diode laser linear array coupling source[J]. Chinese J. Lasers, 2012, 39(2): 0202010
  张 俊,单肖楠,刘 云等.千瓦级高光束质量半导体激光线阵 合束光源[J]. 中国激光, 2012, 39(2): 0202010
- 30 ISO 11146-2005, Laser and Laser-Related Equipment-Test Methods for Laser Beam Widths, Divergence Angles and Beam Propagation ratios [S]. Switzerland: ISO, 2005

<sup>2008. 135~136</sup>